2019年６月吉日

**2019年度 電子顕微鏡講習会（非生物系）**

**文部科学省ナノテクノロジープラットフォーム事業　微細構造解析プラットフォーム**

**名古屋大学　超高圧電子顕微鏡施設**

透過電子顕微鏡を研究に用いている、またはこれから使おうという企業、他大学、公的機関等の研究者を対象に、電子顕微鏡講習会（講義）を下記要領で実施します。

　また、名古屋大学生以外の学生でも４年生以上であれば指導教員の許可を得て、申込が可能です。　　（名古屋大学内の学生は別途ご案内をしますので、お問い合わせください。）

　実技の希望がある方は、別途御相談を承ります。申し込み用紙に希望の有無を記述してください。

 記

○　講　 　　 義 ：電子顕微鏡の基礎

　 　 日　 時 ：令和１年８月５日（月） ９:３０ ～ １５:３０　受付　９：１５～

 　 9:30 ～ 11:30 電子顕微鏡概論 工学研究科材料デザイン専攻 山本 剛久 教授

 　 12:30 ～ 14:00 ＴＥＭ 結像理論 未来材料・システム研究所 齋藤 晃 　教授

 　 14:00 ～ 15:30 S/TEM による分析 未来材料・システム研究所 武藤 俊介 教授

 場 　 所 ： ベンチャービジネスラボラトリー　３階　ベンチャーホール

費　 用　 ：無料

　　　定　　員 　 ：１０名程度

　　　申 込 期 限 ：２０１９年　７月１９日（金）まで

　　　申 込 先 ：「ナノテクノロジープラットフォーム事業

名古屋大学　微細構造解析ＰＦ　事務局

 **問合せ/提出先：****nanoplat@nagoya-microscopy.jp**

 **052-789-3632**  事務担当　中野まで

 ２０１９年　　月　　日

**申込書**

平成３０年度 電子顕微鏡講習会の参加を申し込みます。

・受講希望者の情報

所属

職名

（学生の場合は、専攻と学年と研究室）

氏名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（ふりがな）

E-mail

　（学生の場合は、研究室指導教員のメールアドレスも記入してください。　　　　　　　　）

指導教員名：　　　　　　　　　　E-mail

・電子顕微鏡の利用用途を簡単に記入してください。

　研究目的：

観察方法（研究に必要なものにレ）　　　　　　　　　　　　　　　使用経験

* 像観察 無・　有　 年
* 高分解能像観察 無・　有　 年
* 明視野・暗視野像観察 無・　有　 年
* 転位観察 無・　有　 年
* 電子回折図形観察 無・　有　 年
* 電子回折図形解析 無・　有　 年
* 元素分析 無・　有　 年
* 元素分布分析 無・　有　 年
* その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） 無・　有　 年
	+ 同機関でお申し込みの方が複数の場合も、おひとり様一枚ずつ提出をしてください。
	+ 学生の申し込みの場合には、指導教員の情報も記入してください。

・実技の希望　　　あり　　・　　　なし

　定員3名： 8月5日講義（無料）を受け、希望日を日程調整し、実技講習（有料）を行います。

※「あり」に○をつけた方は、詳細をご連絡いたします。